

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-233560  
 (43)Date of publication of application : 13.09.1996

(51)Int.CI. G01B 11/30  
 G01N 21/88  
 G11B 20/18  
 G11B 20/18  
 G11B 20/18

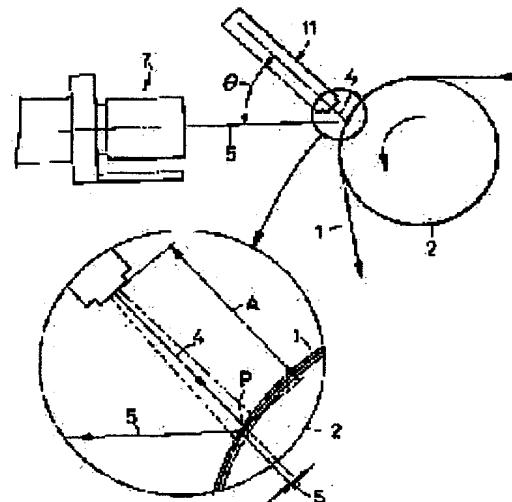
(21)Application number : 07-061714 (71)Applicant : HITACHI MAXELL LTD  
 (22)Date of filing : 23.02.1995 (72)Inventor : TANAKA ICHIRO

## (54) METHOD AND APPARATUS FOR INSPECTING SURFACE OF MAGNETIC RECORDING MEDIUM

### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To so improve the inspecting accuracy as to detect even an infinitesimal defect by devising the disposition of units such as a light emitting unit and a camera in a method for inspecting the surface of a magnetic recording means having the steps of emitting a detection light to the surface of a magnetic layer, receiving the reflected light by a CCD camera, and discriminating between presence and absence of the surface defect.

**CONSTITUTION:** The method for inspecting the surface of a magnetic recording medium comprises the steps of setting light emitting and receiving angles in which the central surface of the optical axes of a detected light 4 and an incident light 5 to a camera 7 to 47 to 60°, thereby improving the output level of a defect signal. The center of the optical axis of the light 5 is disposed at the position where is deviated by 0.3 to 0.6mm from a reflecting point P with the point P of the light 5 of the surface of the magnetic layer as a reference, and the output level of system noise included in the light 5 is reduced.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-233560

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 01 B 11/30			G 01 B 11/30	E
G 01 N 21/88			G 01 N 21/88	G
G 11 B 20/18	501	9558-5D	G 11 B 20/18	501D
	572	9558-5D		572B
		9558-5D		572G

審査請求 未請求 請求項の数11 FD (全8頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平7-61714

(22)出願日 平成7年(1995)2月23日

(71)出願人 000005810

日立マクセル株式会社

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

(72)発明者 田中 一郎

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マ  
クセル株式会社内

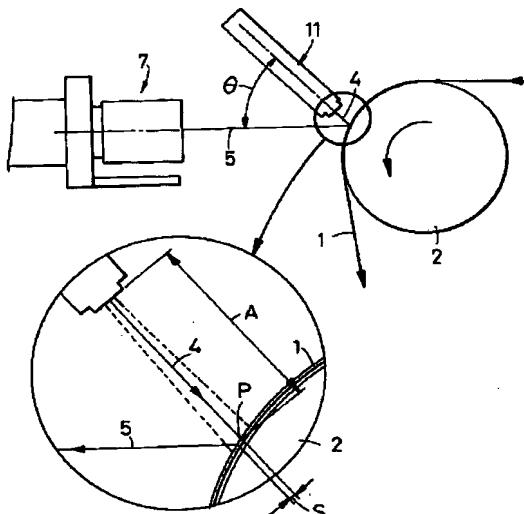
(74)代理人 弁理士 折寄 武士

(54)【発明の名称】 磁気記録媒体の表面検査方法とその装置

(57)【要約】

【目的】 磁性層表面に検知光を照射し、その反射光をCCDカメラで受光して、表面欠陥の有無を判別する表面検査法において、投光器およびカメラなどの機器配置を工夫して、微小欠陥でも検知できるよう検査精度の向上を図る。

【構成】 検知光4とカメラ7への入射光5の光軸中心面で挟む投受光角度θを47～60°に設定し、欠陥部信号の出力レベルを向上する。磁性層表面における検知光4の反射点Pを基準にして、反射点Pから0.3～0.6mm偏倚した位置に、入射光5の光軸中心を位置させ、入射光5に含まれるシステムノイズの出力レベルを減少する。



1 磁気シート 11 投光器  
2 ガイドローラ θ 接受光角度  
4 検知光 P 反射点  
5 入射光 S 偏倚距離  
7 CCDラインセンサーカメラ

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウエブ状の磁気記録媒体1を一定速度で搬送し、その搬送面に沿って配置した投光器11から磁性層表面へ向かって、線状の検知光4を斜めに照射し、磁性層表面からの入射光5を投光器11に対応して設けたCCDラインセンサーカメラ7で受光して表面の欠陥を検出する表面検査方法において、検知光4と入射光5のそれぞれの光軸中心面で挟む投光角度θを、47～60°に設定し、

磁性層表面における入射光5の光軸中心位置が、検知光4の光軸中心の反射点Pから0.3～0.6mm偏倚する状態で表面検査することを特徴とする磁気記録媒体の表面検査方法。

【請求項2】 回転駆動されるガイドローラ2に磁気記録媒体1を巻き掛けて搬送案内し、巻掛部の周方向ほぼ中央に検知光4をローラ中心軸と平行に照射して表面欠陥を検出する請求項1記載の磁気記録媒体の表面検査方法。

【請求項3】 光源10で発生した検知光4を光ファイバー12を介して投光器11へ導入案内し、磁性層表面における照度を40万ルックス以上にして表面欠陥を検出する請求項1又は2記載の磁気記録媒体の表面検査方法。

【請求項4】 ガイドローラ2の周面から圧縮空気を噴出し、磁気記録媒体1をローラ周面から浮上支持した状態で搬送案内する請求項2又は3記載の磁気記録媒体の表面検査方法。

【請求項5】 ウエブ状の磁気記録媒体1を巻き掛けて搬送案内するガイドローラ2と、巻掛部の周面のほぼ中央に向かって線状の検知光4をローラ中心軸と平行に照射する投光器11と、磁性層表面からの入射光5を受光して表面の欠陥を検出するCCDラインセンサーカメラ7とを備えており、

検知光4と入射光5のそれぞれの光軸中心面で挟む投光角度θが、47～60°の範囲内に収まるよう、投光器11およびCCDラインセンサーカメラ7を配置しており、

磁性層表面における入射光5の光軸中心位置が、検知光4の光軸中心の反射点Pから0.3～0.6mm偏倚するよう、CCDラインセンサーカメラ7を指向させてなる磁気記録媒体の表面検査装置。

【請求項6】 ガイドローラ2と、ガイドローラ2を回転駆動する駆動機構を備えており、

ガイドローラ2が焼結された多孔円筒体からなり、その筒内空間が圧縮空気の供給源に接続してある請求項5記載の磁気記録媒体の表面検査装置。

【請求項7】 ガイドローラ2と、ガイドローラ2を回転駆動する駆動機構を備えており、

ガイドローラ2の周面が非付着処理してある請求項5記載の磁気記録媒体の表面検査装置。

【請求項8】 投光器11を含む光源部6を備えており、光源部6の光源10で発生した光を光ファイバー12を介して投光器11に案内し、投光器11が磁気記録媒体1の搬送面の近傍に配置してある請求項5又は6又は7記載の磁気記録媒体の表面検査装置。

【請求項9】 一群のCCDラインセンサーカメラ7がガイドローラ2のローラ中心軸と平行に配置したブラケット13上に調整ホルダー15を介して支持されており、

調整ホルダー15は、ブラケット13に固定した基枠16と、基枠16に対して上下揺動自在に支持された主調整枠18とを含み、

CCDラインセンサーカメラ7が主調整枠18で支持されており、

基枠16と主調整枠18との間に、主調整枠18を調整操作する調整具24が設けてある請求項5又は6又は7又は8記載の磁気記録媒体の表面検査装置。

【請求項10】 調整具24が、主調整枠18を間に挟んで対向状に配置され、それぞれ基枠16にねじ込まれた一对の調整ボルト25・25と、両調整ボルト25にねじ込まれたロックナット26・26と、基枠16と主調整枠18との間に配置されて、主調整枠18を揺動付勢するばね27とを備えている請求項9記載の磁気記録媒体の表面検査装置。

【請求項11】 CCDラインセンサーカメラ7のカメラボディ19に副調整枠20が固定されており、

基枠16と副調整枠20との間に、カメラボディ19をレンズ中心軸の回りに回動調整する調整ボルト28・28が設けてある請求項9又は10記載の磁気記録媒体の表面検査装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、磁気記録媒体の製造過程で用いられて、磁性層表面における欠陥を検出するための表面検査装置、とくにCCDラインセンサーカメラで表面欠陥の検出を行う表面検査装置とその方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 この種の表面検査装置に特開平6-129842号公報や特開平6-129841号公報がある。前者では、ライン状の検知光を所定の入射角で磁性シートに照射し、その反射光をCCDカメラで受光して受光量の違いで表面欠陥の有無を判定する。後者では、走行する磁気テープを周面が鏡面化してある固定円筒体で案内支持し、この支持部外側における反射光をセンサーで受光して表面欠陥の有無を判定している。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 このような表面欠陥を非接触状態で光学的に検知する表面検査装置によれば、検査対象を能率よく検査できる。問題は、検出可能な表

面欠陥の大きさに限界があり、一定程度以下の微小欠陥を充分に検知できないことがある。そのため、従来の磁気記録媒体の場合はともかく、例えばメタルテープのように、信号記録密度が高い磁気記録媒体においては、従来は問題にならなかった微小欠陥が大きなドロップアウトを惹き起すが、こうした高密度記録方式に適用される磁気記録媒体の表面検査に適合できない。

【0004】本発明者はCCDカメラによる表面検査法を再検討し、検出限界を左右している原因を追求した。その結果、CCDカメラの分解能の向上もさることながら、反射光に含まれるシステムノイズの存在が検出限界を大きく左右していることに気付いた。この観点からシステムノイズを最小にするための機器設置条件等を模索し、磁気記録媒体の搬送形態、光源の種類および検知光の照射形態、CCDカメラによる受光形態等を最適化することにより、本発明を完成するに至った。

【0005】本発明の目的は、磁性層表面における小さな欠陥を検出でき、信号記録密度が高度化された磁気記録媒体の表面検査にも十分に対応できる高精度の表面検査方法とその装置を提供するにある。本発明の目的は、磁性層表面の欠陥をリアルタイムで検出でき、ウェブ状の磁気記録媒体の製造ラインにおいて、表面検査を能率よく行える表面検査方法とその装置を提供するにある。本発明の目的は、より高い検査精度が得られながら検査装置に要する費用を従来装置と同程度にまで抑止できる表面検査方法とその装置を提供するにある。本発明の目的は、CCDカメラの微妙な受光条件に対応して、その支持姿勢を適正に微調整できる調整機構を備えた表面検査装置を提供するにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の表面検査方法は、ウェブ状の磁気記録媒体1を一定速度で搬送し、その搬送面に沿って配置した投光器11から磁性層表面に向かって、線状の検知光4を斜めに照射し、磁性層表面からの入射光5を投光器11に対応して設けたCCDラインセンサーカメラ7で受光して表面の欠陥を検出す。こうした検査状態において、検知光4と入射光5のそれぞれの光軸中心面で挟む投受光角度θを47～60°に設定し、磁性層表面における入射光5の光軸中心位置が、検知光4の光軸中心の反射点Pから0.3～0.6mm偏倚する状態で表面検査する。

【0007】具体的には、上記の検査形態において、回転駆動されるガイドローラ2に磁気記録媒体1を巻き掛けて搬送案内し、巻掛部の周方向ほぼ中央に検知光4をローラ中心軸と平行に照射して表面欠陥を検出す。光源10で発生した検知光4は光ファイバー12を介して投光器11へ導入案内し、磁性層表面における照度を40万ルックス以上にして表面欠陥を検出す。ガイドローラ2の周面から圧縮空気を噴出し、磁気記録媒体1をローラ周面から浮上支持した状態で搬送案内する。

【0008】本発明の表面検査装置は、ウェブ状の磁気記録媒体1を巻き掛けて搬送案内するガイドローラ2と、巻掛部の周面のほぼ中央に向かって線状の検知光4をローラ中心軸と平行に照射する投光器11と、磁性層表面からの入射光5を受光して表面の欠陥を検出するCCDラインセンサーカメラ7とを備えている。検知光4と入射光5のそれぞれの光軸中心面で挟む投受光角度θが、47～60°の範囲内に収まるよう投光器11およびCCDラインセンサーカメラ7を配置する。磁性層表面における入射光5の光軸中心位置が、検知光4の光軸中心の反射点Pから0.3～0.6mm偏倚するよう、CCDラインセンサーカメラ7を指向させる。

【0009】具体的にはガイドローラ2と、ガイドローラ2を回転駆動する駆動機構とを備えている。ガイドローラ2は焼結された多孔円筒体からなり、その筒内空間を圧縮空気の供給源に接続する。別のガイドローラ2の場合には、ガイドローラ2の周面を非付着処理する。投光器11を含む光源部6を備えており、光源部6の光源10で発生した光を光ファイバー12を介して投光器11に案内することによって、投光器11を磁気記録媒体1の搬送面の近傍に配置する。

【0010】一群のCCDラインセンサーカメラ7をガイドローラ2のローラ中心軸と平行に配置したプラケット13上に調整ホルダー15を介して支持する。調整ホルダー15は、プラケット13に固定した基枠16と、基枠16に対して上下揺動自在に支持された主調整枠18とを含む。CCDラインセンサーカメラ7を主調整枠18で支持する。基枠16と主調整枠18との間に、主調整枠18を調整操作する調整具24を設ける。調整具24は、主調整枠18を間に挟んで対向状に配置され、それぞれ基枠16にねじ込まれた一对の調整ボルト25・25と、両調整ボルト25にねじ込まれたロックナット26・26と、基枠16と主調整枠18との間に配置されて、主調整枠18を揺動付勢するばね27とで構成する。CCDラインセンサーカメラ7のカメラボディ19に副調整枠20を固定する。基枠16と副調整枠20との間に、カメラボディ19をレンズ中心軸の回りに回動調整する調整ボルト28・28を設ける。

【0011】

【作用】投受光角度θを47～60°に設定し、入射光5の光軸中心(CCDラインセンサーカメラ7のレンズ中心軸)位置を、検知光4の反射点Pから0.3～0.6mm偏倚するのは、それぞれ実験によって、欠陥部信号の出力レベルが最大となり、かつシステムノイズが最小となる投受光条件を探索した結果である。

【0012】最適の投受光角度θを探査するについては、表面欠陥があるテストウェブを用意し、これを所定速度で送りながらCCDラインセンサーカメラ(以下、単にカメラという)7が欠陥部を検知したときの信号出力レベルを計測した。投受光角度θは40°から75°

の範囲で変化させた。その結果、図3に示すように50°～55°付近をピークとする特性曲線が得られた。この実験結果から投受光角度θの実用値として47～60°を選定した。

【0013】入射光5の光軸中心の反射点Pからの偏倚量Sについては、投受光角度θを50°に固定し、入射光5の光軸中心位置を検知光4の反射点Pから僅かずつ遠ざけながら、上記と同様にしてカメラ7の出力信号に含まれるノイズレベルを計測した。その結果、図4に示すように反射点Pから離れるほどノイズレベルが低下することを確認でき、入射光5の輝度が十分でしかもノイズ低減効果が得られる0.3～0.6mmを好適な偏倚量として選定した。

【0014】表面検査は、磁気記録媒体（以下、単に磁気シートという）1を搬送しながら行う。このとき、磁気シート1が例えば厚み方向へ振動し、あるいはウェブ面が部分的にたわみ変形すると、反射光に大量のノイズが含まれてしまう。これを避けるために磁気シート1をガイドローラ2で搬送案内し、検査対象表面を安定的に支持する。ガイドローラ2の周面に圧縮空気を吹き出して、磁気シート1を非接触状態で浮上支持すると、例えば、磁気シート1の裏面に付着していた浮遊塵を除去でき、浮遊塵がガイドローラ2の周面に付着して誤検出状態に陥ることを解消できる。

【0015】光源10で発生した検知光4を光ファイバ～12を介して投光器11へ導入案内するのは、熱影響を避けながら投光器11を磁気シート1の近傍に配置し、検査対象表面における照度を十分に確保するためである。

【0016】先に説明したように、カメラ7のレンズ中心軸は検知光4の反射点Pを基準にして、ごく僅かに偏倚させる必要がある。この偏倚調整を確実にしかも容易に行うために、カメラ7を調整ホルダー15で支持する。カメラ7は主調整枠18に装着されており、主調整枠18を調整具24で傾動調整することによって、レンズ中心軸の偏倚量を変更できる。調整具24を対向する一対の調整ボルト25・25と、ばね27などで構成すると、調整ボルト25・25の調整量に応じて主調整枠18を少量ずつ追隨傾動でき、傾動位置を維持したままで狂いなく主調整枠18を固定できる。副調整枠20は、カメラ7をレンズ中心軸まわりに傾動させて、内蔵するCCD受光素子の配列線を入射光5の光軸中心面と一致させ、CCD受光素子の出力のばらつきを補正する。

【0017】

【発明の効果】本発明では、検知光4と磁性層表面で反射された入射光5とで挟む投受光角度θを47～60°に設定して、表面欠陥部が検知されたとき、より大きな出力レベルの欠陥信号が得られるようにし、小さな欠陥部の場合にも明確な欠陥信号が得られるようにした。さ

らに、入射光5の光軸中心位置を検知光4の反射点Pから僅かにずらして、入射光5に含まれるシステムノイズ量を減少し、カメラ7への入射光5のS/N比を向上した。これにより磁気シート1の表面検査において、微小な表面欠陥を確実に検知でき、従来の検査装置に比べて高精度の表面検査を行える。例えば、メタルテープのように高密度記録方式が適用される磁気シート1においても、ドロップアウトの原因となる表面欠陥を確実に検知して、磁気シート製品の信頼性を向上できる。

【0018】磁気シート1を一定速度で搬送しながら、リアルタイムで表面欠陥を検知できるので、磁気シート1の製造に並行して表面検査を能率よく行える。基本的に従来装置と同様の機器類を用いて、検査時の機器配置を工夫することにより検査精度が向上するので、高い検査精度が得られるにもかかわらず、検査装置に要する費用を従来装置と同程度にまで抑止できる。必要があれば既存の検査装置を利用して、より高い精度の表面検査を行える。

【0019】

【実施例】図1ないし図6は本発明に係る表面検査装置の実施例を示す。図2において表面検査装置は、ウェブ状の磁気シート1を検査対象にして、その製造ラインの後半過程に設置されて磁性層表面の検査を行う。検査時の磁気シート1の搬送姿勢および状態を安定化して、磁性層表面における反射光のノイズレベルを低下するために、磁気シート1を2個のガイドローラ2・3でZ字に搬送案内する。搬送方向上手側のガイドローラ2は、焼結加工された多孔質状の円筒体からなり、図外の駆動機構で磁気シート1の搬送速度（130m/min）に同期して回転駆動する。さらに、図外の供給源から圧縮空気を筒内へ連続供給し、ローラ周面から圧縮空気を噴出し、図1の拡大図に示すように磁気シート1を浮上支持した状態で搬送案内する。このときの浮上量は5～10μmとする。

【0020】上記のように磁気シート1をガイドローラ2に巻き掛けてウェブ面に張力を作用させ、空気膜を介して非接触状態で支持することにより、空間走行部分で表面検査を行う場合に比べて、搬送に伴うウェブ面の振動や局部的な歪みを解消できる。しかも、磁気シート1の裏面側に付着していた塵埃がガイドローラ2へ転移付着するのを防止して誤検出を防止できる。なお、ガイドローラ2としてはローラ周面を非付着処理したローラ、例えば滑性に優れたフッ素樹脂を周面にコーティングしたローラであってもよく、この場合も多孔円筒体からなる上記のローラと同様の安定した搬送状態と、ダスト誤認防止効果とが得られる。搬送方向下手側のガイドローラ3は遊転自在に支持されていて、磁気シート1を次工程へと変向案内する。

【0021】表面検査は、ガイドローラ2の周面のシート巻掛部のほぼ中央へ向かって検知光4を照射し、その

磁性層表面で反射した入射光5を受光して、入射光5の異常の有無を確認することによって行う。そのため検知光4を照射する光源部6と、入射光5を受光するカメラ7と、カメラ7から出力される信号の異常の有無を判定するコンピュータシステム8などの機器を設置する。

【0022】光源部6はハロゲンランプを光源10としており、この光源10と、磁気シート1の巻掛部の外面に対向配置した投光器11と、光源10で発生した検知光4を投光器11へと安定する光ファイバー12とで構成する。図2に示す実施例では、磁気シート1の幅寸法が1000mmなので光源部6のユニットを2セット用意し、各ユニットごとに磁気シート1の幅方向の半分ずつを照射するようにした。各投光器11の照射位置は巻掛部の周方向へ僅かにずらしてある。

【0023】メタルテープあるいはマグネットテープ等の高密度記録に適用される磁気シート1は、磁性層の程色状態が暗色系で検知光4を吸収しやすい。そのため、蛍光灯や自動車用の白熱電球などの散乱光を光源とする場合は、微小欠陥からの反射信号光が微弱で、通常のカメラ7の素子感度では識別可能な受光信号が得られにくい。そこで、この実施例では各光源部6の光源10として高輝度が得られる150Wのハロゲンランプ4個を用い、そこで発生した光のみを光ファイバー12で投光器11へ導入安定し、投光器11を磁気シート1の搬送面の近傍に設置して、磁性層表面における照度が40万ルックスと、従来の検知光の照度の10～30倍になるように増強した。投光器11は市販のファイバースリット投光ヘッドであって、投光スリットから直線状の検知光4を投射する。投光スリットのスリット寸法は0.4mm、幅方向長さは520mmであって、125mmごとに1個のハロゲンランプの投射光を照射する。

【0024】受光用のカメラ7は市販のCCDラインセンサーカメラであって、カメラレンズのF値が1.2、画素数が2048個(20MHzスキャン)、幅方向分解能0.037mm/bit、流れ方向分解能0.2mm/scanなどの仕様を備えている。カメラ7の1台当たりの視野は76mmであって、各投光器11に対応して7台のカメラ7を隣接配置する。具体的にはガイドローラ2のローラ中心軸と平行にプラケット13を配置し、このプラケット13上に7台のカメラ7を配置する。

【0025】本発明は、上記の検査機器に関して、投光器11の配置、検知光4と入射光5の光軸中心面で挟む受光角度θ、および入射光5の位置等を以下のように設定することにより、磁性層表面における微小欠陥を確実に検知できるようにした。

【0026】投光器11は、磁気シート1の検査面の近くに配置するほど反射光のエネルギーが増加する。その一方で、投光スリットにおけるファイバースリットの照射量のばらつきは、投光器11が検査面に近付くほど顕著化し、カメラ7のCCD受光素子の出力にばらつきを

生じる。こうした理由から、投光器11の検査面からの距離寸法Aを23mmに設定し、CCD受光素子の出力のばらつきを防止した。

【0027】投受光角度θの最適値、およびカメラ7の最適受光位置を見出すために、表面欠陥が予め設けてあるテストウェブを用意し、これを所定の速度で搬送しながらカメラ7の信号出力レベルを計測した。投受光角度θについては、θ値を40～75°の間で変化させ、カメラ7が欠陥部を検知したときの欠陥部信号の出力レベルを計測した。図3がその計測結果を示す。得られた特性曲線から明らかな通り、投受光角度θが47～60°の範囲にあるとき、高い出力レベルの信号が得られ、より好ましくは50～55°の範囲にあるとき最大の信号出力を得ることができる。なお、欠陥部がないシート表面の信号出力レベルは、投受光角度θの変化とは無関係にほぼ一定であった。また、光源10の発生光量を40～100%に変化して、欠陥部信号の出力レベルの変化を計測したが、発生光量が70%以上であれば、前記出力レベルに大差のないことを確認した。

【0028】上記の投受光角度θを50°に固定したうえで、上記と同様にテストウェブを搬送しながら、カメラ7の最適受光位置を探索した。通常、検査表面におけるカメラ7のレンズ中心軸の位置、つまり入射光5の光軸中心位置は、検査表面における検知光4の光軸中心での反射点Pに一致させて、より高いエネルギー状態の反射光を入射できるようにする。しかし、こうした受光状態では、高輝度の入射光5が得られるものの、入射光5に多くのシステムノイズが含まれるのを避けられない。そこで入射光5の位置を前記反射点Pから僅かずつ遠ざけ、カメラ7の出力信号に含まれるシステムノイズの出力レベルを計測した。その計測結果を図4に示す。特性曲線から明らかな通り、反射点Pからの偏倚距離Sが0.3mmを越えると、ノイズレベルが急激に減少し、0.5mm～0.6mmの付近でノイズレベルはほぼ一定となる。この計測データと、一定輝度以上の入射光5を確保する必要上、偏倚距離Sを0.3～0.6mmとした。より好ましくは、0.4～0.5mmとする。

【0029】カメラ7の基準位置(後述する軸17の中心位置)と検査表面における入射光5の反射点との間の距離は約240mm強離れており、偏倚距離Sを0.1mm変化させるときのカメラ中心軸の揺動角度は1分25秒とごく僅かでしかない。このような僅かな角度調整を正確に行うために、プラケット13上に調整ホルダー15を固定し、この調整ホルダー15で各カメラ7を支持する。

【0030】図5および図6において、調整ホルダー15は、プラケット13に固定した基枠16と、基枠16に対して軸17を中心にして上下揺動自在に支持された主調整枠18と、カメラボディ19に固定した副調整枠20などで構成する。主調整枠18は羽子板状に形成

し、その板面下部にカメラボディ19を抱持固定する取付穴21を有する。取付穴21の一部は枠周面に達する溝によって切り離されており、溝を介して対向する面壁をボルト22で締め操作することでカメラ7を取付穴21に着脱でき、カメラボディ19をレンズ中心軸まわりに回動調整できる。軸17の軸中心はレンズ中心軸を通る水平面上に位置している。

【0031】主調整枠18は、その上部と基枠16との間に設けた調整具24で軸17を中心にして上下回動操作する。調整具24は、主調整枠18を間に挟んで対向配置され、それぞれ基枠16にねじ込まれた前後一対の調整ボルト25・25と、各ボルト25にねじ込まれたロックナット26・26と、基枠16と主調整枠18の前面との間に配置した圧縮コイル形のばね27とからなる。ばね27は主調整枠18を常に押付勢しており、一方の調整ボルト25を緩め、他方の調整ボルト25を締め込むことにより、各ボルト25の調整量分だけ主調整枠18を平行回動でき、調整結果を直ちに確認できる。

【0032】副調整枠20は、カメラボディ19をレンズ中心軸まわりに回動調整するために設けてあり、その上端を間に挟む基枠16の左右側面にねじ込んだ一対の調整ボルト28・28で傾動操作される。この傾動調整を行うことにより、CCD受光素子の配列線を入射光5の光軸中心面と正しく一致させることができる。副調整枠20を調整操作するときは、先に説明したボルト22を緩める。図5および図6において符号30はCCD受光素子である。

【0033】以上のように構成した表面検査装置の検査能力を確認するために、各種の表面欠陥に対する検出能力をテストし、従来の検査装置と比較した。その結果、磁性層表面に表われる尖鋭突起、繊維プレス（凹み欠陥）、ロール汚れ、Nふち落下、皮ぱり（凸欠陥）、異物の塗込み（凸欠陥）、その他の塵埃および凝集物（凸\*

\*欠陥）の全ての表面欠陥に対して、本発明の検査装置を用いた検査法が、従来の検査法に比べてより高精度に微小欠陥を検知でき、高密度記録方式の磁気シート1の表面検査を十分な精度の許に行えることを確認した。

【0034】上記の実施例では、1個の光源部ユニットに対して、複数個のカメラ7を配列する場合を示したが、本発明はこれとは異なる機器配置を探ることができる。例えば投光器11と1個のカメラ7を一対にして、この対を階段状に配置して表面検査を行うことができる。テープ状に分断され、あるいはディスク状に打ち抜いた磁気シート1を検査対象とする場合にも、本発明の検査方を適用して同様に高精度の検査を行える。

【図面の簡単な説明】

【図1】表面検査装置の配置形態を示す概略側面図である。

【図2】全体装置の概略を示す斜視図である。

【図3】投光光角度θの最適値の探索データを示す図表である。

【図4】入射光の偏倚量に関する最適値の探索データを示す図表である。

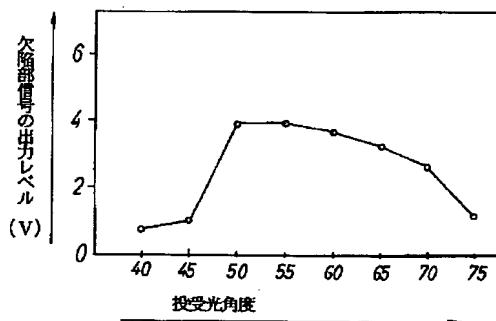
【図5】調整ホルダーの縦断側面図である。

【図6】調整ホルダーの正面図である。

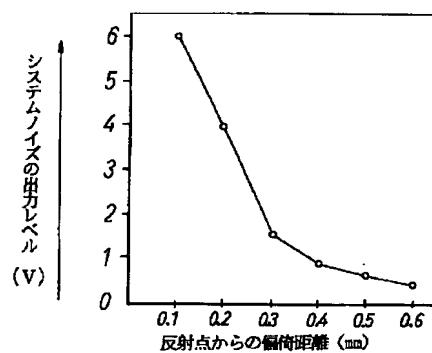
【符号の説明】

- 1 磁気記録媒体
- 2 ガイドローラ
- 4 検知光
- 5 入射光
- 6 光源部
- 7 CCDラインセンサーカメラ
- 11 投光器
- 12 光ファイバー
- 15 調整ホルダー
- P 反射点
- θ 投光光角度

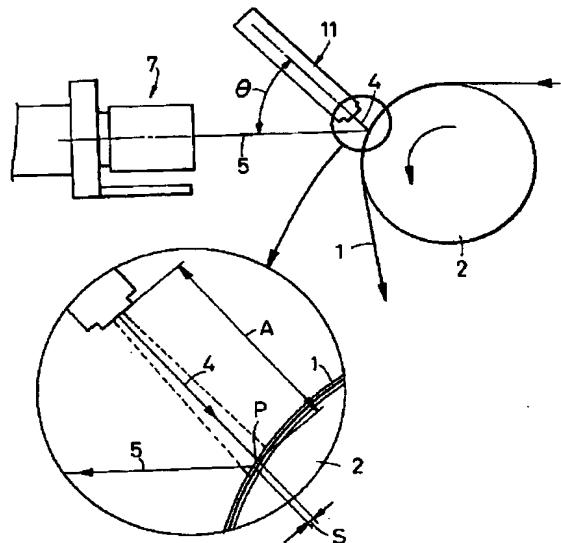
【図3】



【図4】

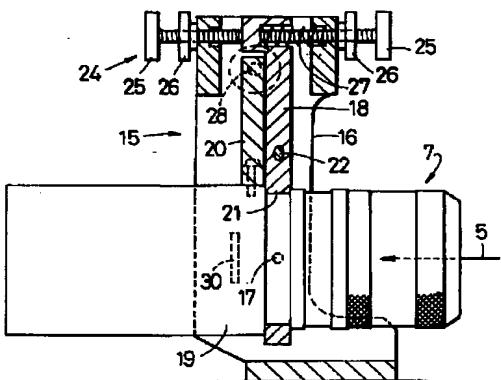


【図1】

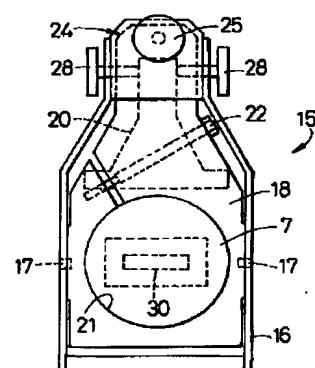


1 磁気シート  
 2 ガイドローラ  
 4 検知光  
 5 入射光  
 7 CCDラインセンサーカメラ  
 11 投光器  
 θ 投受光角度  
 P 反射点  
 S 偏倚距離

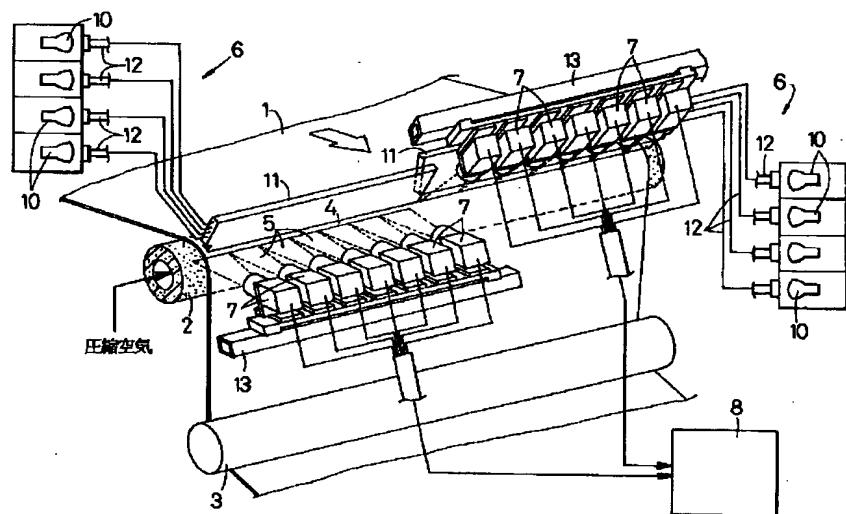
【図5】



【図6】



【図2】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>6</sup> G 11 B 20/18	識別記号 5 7 6	庁内整理番号 9558-5D	F I G 11 B 20/18	技術表示箇所 5 7 6 C
--	---------------	-------------------	---------------------	-------------------